(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-176432 (P2001-176432A)

(43)公開日 平成13年6月29日(2001.6.29)

(51) Int.Cl.7		識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
H01J	31/12		H01J	31/12	С
G 0 9 G	3/20	6 2 4	G 0 9 G	3/20	6 2 4 G
	3/22			3/22	E
H 0 1 J	29/84		H01J	29/84	

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 9 頁)

		T	
(21)出願番号	特願2000-327140(P2000-327140)	(71)出願人	398014609
			ピクステク ソシエテ アノニム
(22)出願日	平成12年10月26日(2000.10.26)		PIXTECH S. A.
			フランス国, 13790 ルーセット, ゼ
(31)優先権主張番号	9 9 1 3 7 5 3		ットイードゥ ルーセット, アベニュ
(32)優先日	平成11年10月28日(1999.10.28)		オリヴィエ ペロワ (番地なし)
(33)優先権主張国	フランス (FR)	(72)発明者	エリク コンペン
(31)優先権主張番号	0004171		フランス国, 30250 アスペール, セ
(32)優先日	平成12年3月31日(2000.3.31)		デクス 1220, ルマデエール
(33)優先権主張国	フランス(FR)	(74)代理人	100074930
			弁理士 山本 惠一

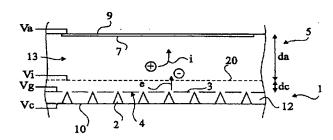
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 保護グリッドを有するフラットディスプレイスクリーン

(57) 【要約】

【課題】 電極間空間内に存在する正イオンからカソードを保護するフラットディスプレイスクリーンを提供する。

【解決手段】 電界効果の電子放出手段(2)を備えたカソード(1)と、カソード(1)の反対側に配置されたカソード発光アノード(5)と、カソード(1)に対応付けられた抽出グリッド(3)と、少なくとも1つのフィルタリンググリッド(20、30、40)とを含み、フィルタリンググリッドは、電子衝撃に対して透過性を有し、このフィルタリンググリッドの一方の側に発生した寄生イオンが、他方の側に配置されたカソード又はアノードに到達することを禁止するようにバイアスされるフラットディスプレイスクリーンである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 電界効果の電子放出手段(2)を備えた カソード(1)と、

前記カソード(1)の反対側に配置されたカソード発光 アノード(5)と、

前記カソード(1)に対応付けられた抽出グリッド (3) と、

少なくとも1つのフィルタリンググリッド(20、3) 0、40)とを含み、

前記フィルタリンググリッドは、電子衝撃に対して透過 10 法。 性を有し、このフィルタリンググリッドの一方の側に発 生した寄生イオンが、他方の側に配置された前記カソー ド又は前記アノードに到達することを禁止するようにバ イアスされることを特徴とするフラットディスプレイス クリーン。

前記フィルタリンググリッド(20、3 【請求項2】 0、40)を、前記アノード(5)の最高バイアス電位 (Va) よりも高い電位 (Vi) にバイアスできること を特徴とする請求項1に記載のスクリーン。

【請求項3】 前記フィルタリンググリッド(30) を、負又は零電位(Vi)にバイアスできることを特徴 とする請求項1又は2に記載のスクリーン。

【請求項4】 前記フィルタリンググリッド(30)の 前記バイアス電位(Vi)は、表示周期以外の前記負又 は零電位と、表示周期中の前記アノード(5)の最高バ イアス電位(Va)よりも高い前記電位との間で切替可 能であることを特徴とする請求項2又は3に記載のスク リーン。

【請求項5】 前記フィルタリンググリッド(20、4 0) は、前記アノード(5) よりもカソード(1) の近 30 くに置かれることを特徴とする請求項1又は2に記載の スクリーン。

【請求項6】 前記アノード(5)の最高バイアス電位 (Va) よりも高い電位にバイアスされる第1のフィル タリンググリッド(40)と、該第1のフィルタリング グリッドよりもアノードの近くに配置された第2のフィ ルタリンググリッドとを含むことを特徴とする請求項1 から5のいずれか1項に記載のスクリーン。

【請求項7】 前記第2のフィルタリンググリッド(4 0´)は、前記アノード(5)の最高バイアス電位より 40 も低く、好ましくは前記カソード(1)の最小バイアス 電位(Vc)よりも低い電位にバイアスされることを特 徴とする請求項6に記載のスクリーン。

【請求項8】 前記第1のフィルタリンググリッド(4 0) の前記バイアス電位は、表示周期以外の負又は零電 位と、表示周期中の前記アノード(5)の最高バイアス 電位(Va)よりも高い電位と、の間で切替可能である ことを特徴とする請求項6に記載のスクリーン。

【請求項9】 少なくとも1つの前記フィルタリンググ リッド(20、30、40、40~)は、前記アノード 50 子を抽出するために、カソード1とグリッド3との間に

(5) 又は前記カソード(1) に集積されることを特徴 とする請求項1から8のいずれか1項に記載のスクリー

【請求項10】 表示周期の間に挿入された再生周期中 に、前記抽出グリッド(3)及び前記カソード(1)の 電位よりも高い電位に前記アノード(5)をバイアスす る段階と、負又は零電位に前記追加グリッド(30)を バイアスする段階とを含むことを特徴とする、請求項1 から9のいずれか1項に記載のスクリーンを制御する方

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、フラットマイクロ チップディスプレイスクリーン、具体的にはカソード発 光スクリーンと称されるものに関する。そのアノード は、絶縁領域によって相互に分離され、電子衝撃によっ て励起されやすい、発光素子を支持する。この電子衝撃 は、発光素子をバイアスするために必要であり、低い抽 出電位でマイクロチップ又は層から発生することができ 20 る。

【0002】この説明を簡単にするために、マイクロチ ップスクリーンのみについて以下では検討するが、本発 明は、一般的に、種々の前述したタイプのスクリーン及 びその均等物に関することに注目すべきである。

[0003]

【従来の技術】図1は、本発明が関係するタイプのフラ ットカラーマイクロチップスクリーンの従来の構造の一 例を表している。

【0004】このようなマイクロチップスクリーンは、 本質的に、マイクロチップ2を有するカソード1と、該 マイクロチップの位置に対応するホール4を備えた抽出 グリッド3とから形成される。カソード1は、カソード 発光アノード5の反対側に配置され、そのガラス基板6 は、例えばスクリーン表面を形成する。

【0005】マイクロチップスクリーンの動作原理及び 具体的な実施形態は、例えばコミッサリア タ レエネ ルジ アトミークの米国特許第4940916号公報に 記載されている。

【0006】カソード1は、複数行から構成され、例え ばガラスからなる基板10上に、導電層を網状に構成し たカソード導体から形成される。マイクロチップ2は、 カソード導体上にデポジットされた抵抗層11上に作ら れる。図1は、カソード導体を表すことなく、網の内側 を部分的に表している。カソード1は、複数行に構成さ れたグリッド3に対応する。グリッド3は、挿入された 絶縁層12を有するカソードプレート上にデポジットさ れる。グリッド3の行とカソード1の列との交点が、画 素を規定する。

【0007】このデバイスは、マイクロチップ2から電

作られた電界を用いる。そして、適切にバイアスされる と、電子は、アノード5の蛍光素子7に引きつけられ る。図1に描かれたようなカラースクリーンの場合、ア・ ・ノード5は、例えば、色(赤、緑及び青)に各々対応す る蛍光素子7 r、7g及び7bの交互ストリップを備え ている。ストリップは、絶縁体8によって互いに分離さ れている。蛍光素子7は、電極9上にデポジットされ る。該電極9は、例えば、インジウム及びすず酸化物 (IT〇) のような (アノードがスクリーン表面を形成 するならば透過性のある) 導電層の対応するストリップ 10 から形成される。赤、緑及び青のストリップ群は、例え ば、カソード1に対して交互にバイアスされる。従っ て、カソード/グリッドの画素のマイクロチップ2から 抽出された電子が、色の各々に対向する蛍光素子 7 に交 互に向けられる。モノクロスクリーンの場合、アノード 5は、1つの平面、即ちこの場合別々にバイアスされる 2つの群の交互ストリップの中に構成された、同一色の 蛍光素子を支持する。

【0008】前述したような他のカソードーグリッド及 びアノードの構造が、理解できる。例えば、アノード蛍 20 光素子は、スクリーン画素の大きさに対応するき基本パ ターンで分散されてもよい。アノードは、更に、ストリ ップの幾つかの群又は蛍光素子の基本パターンから形成 されるとしても、ストリップの群又はパターンによって 切り替えられなくてもよい。全てのストリップ又はパタ ーンは、例えば導電面によって支持されることによっ て、同一電位となる。そのとき、アノードは、色が交互 にパイアスされる「切替」と逆に「非切替」にされる。 【0009】励起された蛍光素子を支持するアノードパ ターンのストリップは、カソードに対して数百ポルトの 30 電圧にバイアスされる。幾つかのストリップ群を持つ切 替アノードを有するスクリーンの場合、他のストリップ は零電位になる。バイアス電位の値の選択は、蛍光素子 の特性及びカソード側の放出手段の特性とつながる。

【0010】カソードマイクロチップによる電子放出の ために、カソードは、グリッド3にと比較して十分な電 位差にされなければならない。従来、カソードとグリッ ドとの間が50 Vのオーダの電位差の下で、電子放出は 生じず、用いられる最大放出は、80 Vのオーダの電位 差に対応する。例えば、グリッド3の行は、実質的に8 0 Vのオーダの電位にバイアスされる。カソード1の列 は、最大放出電位と非放出電位との間の範囲のそれぞれ の電位(例えばそれぞれ0V及び30V)に、もたらさ れる。従って、1行の全ての画素の輝度が、(アノード が、色毎に選択的にバイアスされる幾つかのストリップ 群を含むならば、色部品当たりで) 設定される。従来の スクリーン制御モードは、秒当たり、例えば50から6 0の画像を形成することからなる。従って、約20ms の期間は、各イメージを形成するために利用可能であ る。この期間は、フレーム期間と称される。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】従来のスクリーン内に生じる問題は、イオンが電極間空間13内に存在することである。実際に、電極間空間は真空の下で作られる。層は、種々の電極から構成され、残留ガスは、電子衝撃の影響の下でイオンを発生させる。そのとき、これら正イオンは、最低電位で電極に引きつけられる。

【0012】(ディスプレイフレーム又は副フレーム中の)通常の動作において、電子によるアノードの蛍光素子の衝撃が、正イオンの発生に起因する。これら陽イオンは、そのとき、最低電位であるカソードに向かって加速され、物理的に又は化学的にそれを損傷することができる。

【0013】いくつかのスクリーンにおいて、再生アドレッシングモードと称されるものは、周期的で且つディスプレイ周期以外で、放出状態へカソードマイクロチップをもたらし、アノード電極が低電位にバイアスされる。このタイプの制御方法の一例が、欧州特許出願0747875号に記載されている。

【0014】生じる問題は、アノードによってもはや引きつけられないために、カソードによって放射された電子が抽出グリッド上でフォールバックすることである。この現象は、グリッド表面で吸収された種のイオン化に従う。従って、生じた陽イオンは、零電位であるアノードへ向かって加速され、蛍光素子を汚染する。再生段階中のこのアノードのイオン衝撃は、スクリーンのオン及びオフの領域で異なるエージングを生じる。実際に、再生段階中のオフ領域の蛍光素子の光効率の低下が、観察される。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明は、寄生イオンの 悪い効果に対して保護するスクリーンの新規な構成を提 供することによって、従来のスクリーンの課題を解決す ることを目的とする。本発明は、特に、電極間空間内に 存在する正イオンからカソードを保護することを目的と する。カソードは、実際に、化学的又は物理的な汚染 に、特に影響されやすい。このような場合は、特にマイ クロチップスクリーンの場合である。

【0016】また、本発明は、実現が特に簡単であり、 従来のスクリーンのアノード、カソード又は抽出グリッ ドのいずれも変更する必要がない、解決策を提供するこ とも目的とする。

【0017】更に、本発明は、カソードーグリッド及びマイクロチップスクリーンアノードの従来の製造工程を変更することなく実現できる解決策を提供することも目的とする。

【0018】第1の態様によれば、本発明は、スクリーン電極の従来のアドレス指定を変更する必要がなく、特にアノード、カソード及び抽出グリッドのそれぞれのアドレス指定電位を変更する必要がない解決策を提供する

ことを目的とする。

【0019】第2の態様によれば、本発明は、電子衝撃 に対してアノードの蛍光素子を保護すると共に、従来の 再生周期を実行する可能性を維持することを目的とす る。

【0020】これら目的を達成するために、本発明は、 電界効果の電子放出手段を備えたカソードと、カソード の反対側に配置されたカソード発光アノードと、カソー ドに対応付けられた抽出グリッドと、少なくとも1つの ッドは、電子衝撃に対して透過性を有し、このフィルタ リンググリッドの一方の側に発生した寄生イオンが、他 方の側に配置されたカソード又はアノードに到達するこ とを禁止するようにパイアスされるフラットディスプレ イスクリーンを提供する。

【0021】本発明の一実施形態によれば、フィルタリ ンググリッドを、アノードの最高バイアス電位よりも高 い電位にバイアスできる。

【0022】本発明の一実施形態によれば、フィルタリ ンググリッドを、負又は零電位にバイアスできる。

【0023】本発明の一実施形態によれば、フィルタリ ンググリッドのバイアス電位は、表示周期以外の負又は 零電位と、表示周期中のアノードの最高バイアス電位よ りも高い電位と、の間で切替可能である。

【0024】本発明の一実施形態によれば、フィルタリ ンググリッドは、アノードよりもカソードの近くに置か れる。

【0025】本発明の一実施形態によれば、アノードの 最高バイアス電位よりも高い電位にバイアスされる第1 のフィルタリンググリッドと、該第1のフィルタリング 30 グリッドよりもアノードの近くに配置された第2のフィ ルタリンググリッドとを含む。

【0026】本発明の一実施形態によれば、第2のフィ ルタリンググリッドは、アノードの最高バイアス電位よ りも低く、好ましくはカソードの最小バイアス電位より も低い電位にバイアスされる。

【0027】本発明の一実施形態によれば、第1のフィ ルタリンググリッドのバイアス電位は、表示周期以外の 負又は零電位と、表示周期中のアノードの最高バイアス 電位よりも高い電位との間で切替可能である。

【0028】本発明の一実施形態によれば、少なくとも 1つのフィルタリンググリッドは、アノード又はカソー ドに集積される。

【0029】また、本発明は、表示周期の間に挿入され た再生周期中に、抽出グリッド及びカソードの電位より も高い電位にアノードをバイアスする段階と、負又は零 電位に追加グリッドをバイアスする段階とを含む方法を 提供する。

【0030】本発明の前述した目的、特徴及び効果は、

説明の中で詳細に説明される。

[0031]

【発明の実施の形態】種々の図面の中で、同一参照符号 は同一構成素子を示している。明確にするために、本発 明の理解に必要な構成素子だけを図面の中に表し、以下 で説明する。特に、本発明によるスクリーンのカソード グリッド又はアノードの形態は、詳細に説明せず、特 に示さない限り本発明の対象物ではない。本発明は、い ずれの従来のスクリーン構造にも、即ちそのカソード-フィルタリンググリッドとを含み、フィルタリンググリ 10 グリッド及びそのアノードがどのような構造であっても 適用できる。更に、簡単にするために、構成部品の位置 を説明したいとき、参照符号をカソードーグリッド組立 体を指示するカソードに付す。

> 【0032】本発明の特徴は、フラットディスプレイス クリーンの抽出グリッドとアノードとの間に、少なくと も1つの追加フィルタリンググリッドを提供する。該追 加フィルタリンググリッドは、寄生イオンの軌道を改善 し、追加フィルタリンググリッドの一方の側に現れ、ス クリーンの範囲を定める電極(アノード又はカソード) 20 に到達するようにこのグリッドの他方の側へ伝播する寄 生イオンを妨げるようにバイアスされる。

【0033】本発明の第1の態様によれば、1つ以上の 追加フィルタリンググリッドは、特に、アノードから放 出され、カソードに到達するようになされる正イオンに 対して、バリアを形成する。

【0034】本発明の第2の態様によれば、1つ以上の 追加フィルタリンググリッドは、2つの表示周期の間の 少なくとも1つの再生周期中に、電極間空間に存在する イオンを捕獲する。

【0035】図2は、本発明の第1の態様に従って、フ ラットディスプレイスクリーンの第1の実施形態を、部 分的且つ概略的に表している。図2において、種々の素 子が、断面図として記号的に表されている。

【0036】従来、本発明のフラットマイクロチップス クリーンは、蛍光素子7を支持する1つ又は幾つかのア ノード電極9と、その反対側に配置された電子放出マイ クロチップ2を支持するカソード電極10とを含む。ま た、従来、マイクロチップの位置にホール4を有する抽 出グリッド3は、(参照符号1で指示された)カソード に対応し、絶縁層12上にデポジットされている。電極 間空間13は、通常、真空にされる。

【0037】本発明の第1の態様によれば、少なくとも 1つの追加フィルタリンググリッド20は、カソードー グリッド1と(参照符号5によって指示された)アノー ドとの間に配置される。この第1の態様によれば、グリ ッド20の主な機能は、カソード1を、アノード5から 発生した正イオンの衝撃から防ぐことである。この目的 のために、この実施形態の特徴によれば、グリッド20 は、アノード5の最大バイアス電位Vaよりも高い電位 添付図面と共に、以下の具体的な実施形態の限定しない 50 Viにバイアスされる。従って、グリッド20とアノー

ド5との間の空間(間隔da)に位置する陽イオンiは、最低電位にあるアノードに引きつけられる。パイアス電位Viは、電位Vaよりも少なくとも20ボルト大きいことが好ましい。この20ボルトの値は、イオンがグリッド20を横切ることを防ぐために必要な電位バリアの振幅に対応して、選択される。一般に、これら創出される陽イオンの運動エネルギは、数電子ボルトになる。

【0038】図2に描かれた第1の態様によれば、1つの追加グリッド20が設けられている。グリッド20は、電極間空間13において、アノード5よりもカソード1に近いところに配置されるのが好ましい。従って、グリッド20は、電極間空間13内に位置する残留ガス分子のイオン化から生じる正イオンがカソードに到達することを防ぐという、第2の効果を有する。グリッド20は、カソードプレートによって支持されるものであってもよい。

【0039】図3は、第1の態様に従って、本発明の第2の好ましい実施形態を、図2の断面図と同様の簡単な断面図で表している。

【0040】この実施形態によれば、電極間空間13内に2つの追加グリッド40及び40~が設けられている。第1の実施形態のグリッド20と同様に、第2のグリッド40~よりもカソード1に近いところにある第1のグリッド40は、該グリッド40よりもアノード5の側に存在する陽イオンiがカソード1に到達することを防ぐ機能を有する。グリッド40は、グリッド20と同様に、アノードの最大電位よりも高い電位Vi1にバイアスされる。

【0041】アノード5と第1のグリッド40との間に 30 配置された第2のグリッド40´は、空間13内で、電界の第2の反転をさせる機能を有する。これは、本質的に、電子衝撃の後でアノードから放出された、負イオン c及び二次電子esの軌道を妨害することを可能にする。そうしないと、これら負の電荷種は、第1のグリッド40によって引きつけられる。一度、グリッド40において中立化すると、これら種は、グリッド40の電子衝撃によってイオン化される。そして、グリッド40とカソード1との間に位置する陽イオンを創出し、それがカソード1に引きつけられる。 40

【0042】本発明によれば、グリッド40 だは、負の種(陰イオン及び二次電子)をアノード5 へ反発するように、そのアノード5 の最大バイアス電位 V a よりも低い電位 V i 2 にバイアスされる。これは、カソードから放出された電子が、アノードに引きつけられて留まらなければならないことと同じである。電位 V i 2 は、カソードの最小バイアス電位 V c よりも低くするのが好ましい。従って、カソードから放出された電子は、グリッド 40 だよって集められた分子を取り除くリスクがない。

【0043】アノードから放出された陽イオンiは、該アノード又は最低電位のグリッド40~によって集められると共に、グリッド40によって反発するので、カソードに到達するリスクがないことに注目すべきである。

【0044】電界の1つの反転が行われる第1の実施形態に対して、アノードとカソードーグリッドとの間で電界の向きの二重反転が行われる第2の実施形態の効果は、カソード1が、アノードから発生した陽イオン及び陰イオンの両方から保護されることである。第1の実施10 形態については、電極間空間13内に含まれた残留ガスのイオン化によって発生した陽イオンからカソードを保護することができるように、グリッド40はカソードの近くに配置されるのが好ましい。

【0045】図4A及び図4Bは、本発明の第2の態様の実施形態によるフラットマイクロチップを、図2及び図3と類似の表現で表している。

【0046】この第2の態様によれば、追加フィルタリンググリッドは、特に再生周期中に電子のフォールバックの効果により抽出グリッドから放出されたイオンを捕20 獲する機能を有する。

【0047】従来、この第2の態様によるマイクロチップは、図2及び図3のスクリーンと同様に、電子放出マイクロチップ2に対応するカソード電極10を含む、参照符号1で指示されたカソードを形成する。抽出グリッド3は、挿入された絶縁体12を有するカソード1上にデポジットされる。グリッド3は、蛍光素子7を指示する1つ又は幾つかの電極9から形成された電極5に向かう電子の軌道を可能にするために、マイクロチップの位置にホール4を設けている。

【0048】本発明の第2の態様によれば、追加グリッド30は、電極間空間13内でカソード1とアノード5との間に配置される。これは図面に表されていないけれども、グリッド3は、図2のグリッド20と同様に、カソードの近くに配置されるのが好ましい。

【0049】スクリーンが表示段階(図4A)にあるか 又は再生段階(図4B)にあるかによって、グリッド3 0は、異なる電位の信号Viによってアドレス指定され る。従って、本発明の第2の態様は、詳細には、表示周 期(フレーム又は副フレーム)の間に再生段階に制御さ 40 れるマイクロチップスクリーンに適用される。

【0050】図5は、本発明の一実施形態によれば、図4A及び図4Bのスクリーンの種々の素子をアドレス指定するための信号の形状の一例を、タイミング図の形式で描いている。この図は、表示周期Aの間及び再生周期Bの間それぞれに、アノード5の電位Vaと、カソード1の電位Vcと、抽出グリッド3の行の電位Vgと、追加グリッド30の電位Viとをそれぞれアドレス指定することを表している。

【0051】本発明のこの実施形態に従って、本発明の 50 第1の態様によれば、グリッド30の電位Viは、表示

周期中に、アノード5の最大アドレス指定電位Vaよりも高くなるように選択される。従って、これら周期(図4A)中に、グリッド30とアノード5との間に存在する陽イオンiは、アノード5に捕獲される。カソードから放出された電子eは、アノード5に到達するように、電極間空間13内を通常通り伝播する。更に、電位間の関係が同じであるために、第1の態様の中で説明したものと同じ効果が得られる。図5において、特定の画素の輝度設定値に従って、電位Vcが0から30Vo間の値をとるということが、斜線によって描かれている。

【0052】図5に描かれた例において、アノード5の電極9が250V電位でアドレス指定され、抽出グリッド3が行当たり70V電位でアドレス指定されていることを想定している。グリッド30は、例えば、表示周期A中に300Vのオーダの電位にバイアスされる。

【0053】前述された欧州特許出願第0747875号に記載されたタイプの再生段階で行われるフレーム帰線(fly-back)周期B中に、この実施形態によれば、追加グリッド30が零電位にもたらされる。

【0054】再生段階において、前述した文章の中で説 明した方法と異なって、アノード5の全ての電極9が正 電位におかれる。フィルタリンググリッド30は、零又 は更に低い電位に下げられる。しかしながら、カソード 1のマイクロチップ2は、最大放出電位(例えば80V にバイアスされたグリッド3に対して0V)におかれ る。(グリッド3でフォールバックした、マイクロチッ プから放出された電子のために)抽出グリッド3から放 出された陽イオンは、零電位にあるフィルタリンググリ ッド30に引きつけられる。アノードがグリッド30の 電位よりも高い電位に維持されるために、陽イオンi は、グリッド30か、又は近くで曲がった後のグリッド 3かのどちらか一方によって集められる。再生周期中 に、グリッド30をバイアスすることは所望の動作と同 じであり、即ち電子がアノード5に引きつけられないこ とに注目すべきである。実際に、グリッド30は、電子 衝撃に対するシールドとして作用し、高い電位の抽出グ リッド3へ向かって反発される。

【0055】もちろん、実際に、カソード及びグリッド電極は、複数行及び複数列の構成に従ってアドレス指定され、アノード電極は、カラースクリーンの場合に色に 40よってアドレス指定されてもよい。しかしながら、これは、本発明の動作を基本的に変更しない。それゆえ、図5において、表示周期A中に電位Vcでアドレス指定するカソード行は、0から30Vの間の範囲の任意の電位によって描かれ、対応するグリッド3の行は、実質的に70V電位にバイアスされる。もちろん、アドレス指定されないグリッド行と、切替カラーアノードの場合のアドレスされない色のアノード電極とは、0V電位になる。

【0056】本発明の第2の態様の効果は、アノード側 50 方向又は二方向(垂直である必要はない)のスクリーン

におけるカラードリフト、又はカソードの絶縁領域の充電効果に対するブレイクダウンを避けるために別に用いられる、フラットディスプレイスクリーンの再生段階の不利な効果を妨げることである。

【0057】図3及び図6によって描かれた本発明の第2の態様の他の実施形態によれば、スクリーンは、二重グリッド40及び40~で動作するものであってもよい。表示周期中に、スクリーンは、図3に関して説明された第2の態様に従って動作する。即ち、追加グリッドは、アノードから放出されたイオンから、及びグリッド40とアノードとの間の残留イオン化ガスから、カソードを保護する。表示周期以外(図6)、即ち再生周期中に、グリッド40は、電位Vcよりも低い電位Vilに下げられ、グリッド40~は、陽イオンがグリッド40~に到達しないように電位Vgよりも高い電位Vilにもたらされる。そして、アノードは、カソード側で放出された陽イオンから保護される。

[0058] 本発明の効果は、検討されたいずれの態様 も、アノード、カソード及び抽出グリッドに関するフラ ットディスプレイスクリーンの従来の構造を考慮してい ることである。

【0059】検討されたいずれの態様も、マイクロチップスクリーンの場合に、イオン衝撃に非常に良く感応する構成素子を含むカソードが、このような衝撃に対して保護されることに注目すべきである。

【0060】本発明の別の効果は、フラットディスプレイスクリーンの従来のアドレス指定と完全に同じであることである。

【0061】1つ以上の追加グリッド20、30、40 又は40 位、金属であるのが好ましく、カソードからアノードへの電子衝撃 e を妨害することを妨げるために強い透過性を有するように作られる。例えば、グリッド20は、開口が、その表面の80%を占める。実際に、グリッドの透過性は、その網の電位の行の妨害に依存する。例えば、図3について、グリッド40 位、非常に透過的でなければならない(網の内側の電界行を、電位Vcよりも高い電位に留めなければならない)が、その導体は、電子によって衝撃されることを妨げるために、電位Vcよりも低い電位になる。

【0062】1つ以上の追加グリッド20、30又は40は、何らかの適合手段、例えば絶縁スペーサによってカソード1とアノード5との間に維持された独立プレートであってもよい。該絶縁スペーサは、グリッドの固有機械的保持(intrinsic mechanical hold)に従って、スクリーン表面に一様に分布するのが好ましい。しかしながら、所望のフィルタリング機能に適合したいずれかの他の構造を備えてもよい。例えば、グリッドは、アノード又はカソードによって支持された絶縁パッドに一様に分散され又はおかれた導体ペレット又はグリッドの、一方向又は二方向(垂直である必要けない)のフクリーン

の辺の間に伸びたワイヤから形成されてもよい。

【0063】他の実施形態として、1つ以上の追加グリ ッドが、金属である代わりに、抵抗又は半導体グリッド であってもよいことに注目すべきである。

【0064】もちろん、本発明は、当業者によれば容易 に種々の変更、修正及び改善をすることができる。特 に、アノードから及びカソードから追加グリッドまでの 離す距離の選択は、選択された実施形態に、及びありう る技術的なスクリーン製造の制約に依存する。例えば、 特定の場合、蛍光素子を汚染することを避けるためにア 10 リーンの第1の実施形態の断面図である。 ノード上に金属グリッドを直接置くことは好ましくな い。中間スペーサ構造は、それらの上に自己支持グリッ ドを吊すことを提供しなければならない。しかし、1つ 以上の追加グリッドは、集積電子回路における製造技術 を用いることによってカソードーグリッド及び/又はア ノードに集積されて提供されてもよい。

【0065】このような製造技術を用いる本発明の実現 の一例は、図7に表されている。前述の図に関連して説 明された種々の構成部品(基板6及び10と、カソード 導体11 と混同して表された抵抗層11と、マイクロ 20 チップ2と、絶縁層12と、ホール4を設けた抽出グリ ッド3と、アノード導体9と、蛍光素子7と)が、表さ れている。グリッド40は、挿入された絶縁層50を有 するグリッド3上にデポジットされること(導電層デポ ジション)によってカソードから支持され、例えば画素 パターンに従って開口される。グリッド40 ′は、アノ ードによって支持され、基本アノードパターン(9、

7) の間に挿入された、例えば(少なくとも表面の)バ イアス可能な導電パッド51によって形成される。電位 Vi1及びVi2は、前述で説明した状態(特に図3に 30 関して)を考慮して、等電位に設定される。

【0066】更に、本発明は、モノクロスクリーン又は カラースクリーンについて、実現でき且つ重要であり、 本発明の第2の態様に従ってアドレス指定することに必 要な適合は、前述の機能的な説明に基づいて当業者の能 力によって可能となる。特に、本発明は、どのような画 素構成でも、蛍光素子に対するどのようなアノードの分 散でも実現される。

【0067】更に、本発明はマイクロチップスクリーン に関して前述してきたけれども、通常、カソード蛍光ア 40 ノードが電子衝撃にさらされる電界効果スクリーンの全 てのタイプに適合できることに注目すべきである。

【0068】このような変更、修正及び改善は、この開

示の部分の中にあり、本発明の技術的思想及び見地の中 になる。従って、前述の説明は、単なる例としてであ り、限定するものではない。本発明は、特許請求の範囲 及びその均等物として規定されたものにのみ限定され る。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来技術と解決課題とを表すフラットカラーマ イクロチップスクリーンの構造図である。

【図2】本発明の第1の態様に従うマイクロチップスク

【図3】本発明の第1の態様に従うマイクロチップスク リーンの第2の実施形態の断面図である。

【図4A】本発明の第2の態様に従うマイクロチップス クリーンの実施形態における、第1の動作段階を表す断 面図である。

【図4B】本発明の第2の態様に従うマイクロチップス クリーンの実施形態における、第2の動作段階を表す断 面図である。

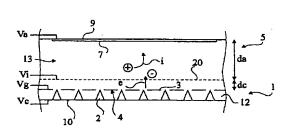
【図5】図4A及び図4Bのスクリーンを制御する本発 明による方法の一実施形態のタイミング図である。

【図6】本発明の第2の態様に従うスクリーンの他の実 施形態の動作を、図3と同様に表して断面図である。

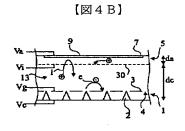
【図7】本発明の第1の態様の第1の実施形態に従うス クリーンの断面図である。

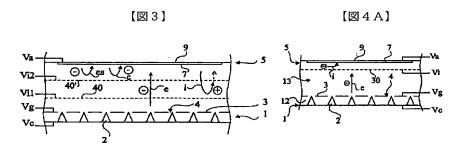
【符号の説明】

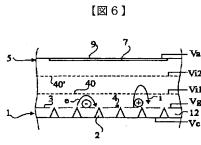
- カソード、カソードーグリッド
- 2 電子放出マイクロチップ
- 3 抽出グリッド
- ホール
- アノード導体、カソード発光アノード、アノード電 5 極
 - 6 ガラス基板
 - 7、7g、7r、7b 蛍光素子
 - 8 絶縁体
 - 9 アノード電極
 - 10 カソード電極、基板
 - 11、11 抵抗層
 - 12 絶縁層
 - 13 電極間空間
- 20、30、40、40 追加フィルタリンググリッ ド
 - 5 0 絶縁層
 - 5 1 導電パッド

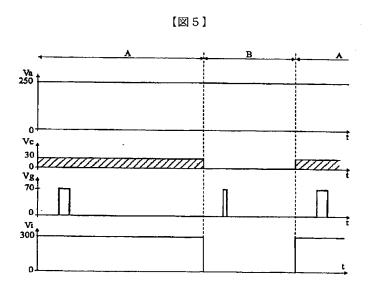


【図2】

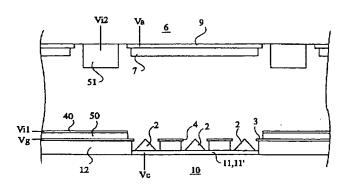








【図7】



フロントページの続き

(72)発明者 エルヴェ シーガルフランス国, 34090 モンペリエ, リュ デュ フォブール ブートネ, 23番地, レジダンス 24